

機器貸付料 新旧対照表

基本額(円)(1機につき1時間)

No.	機器名	型式	メーカー	改定前	改定後
1 精密測定検査用					
007	投影機	VS-300	神港精機	250	280
172	画像測定機	Smart ScopeVantage 600	OGP	4,480	5,100
175	レーザプローブ式非接触三次元測定装置	NH-3SP	三鷹光器	3,770	4,290
188	精密真円度・円筒形状測定機	タリロンド595	アメテックス(株)テラーホブソン事業部	5,610	6,390
197	曲面微細形状測定システム (接触式測定)	フォームタリサーフPGI 1200	アメテックス(株)テラーホブソン事業部	4,480	5,100
198	曲面微細形状測定システム(非接触式測定)	VR-3200	キーエンス	1,120	1,270
301	定盤 (場所:綾部)	グラプレートNo.517-409	ミツトヨ	150	170
302	チェックマスタ (場所:綾部)	HMC-1000H	ミツトヨ	150	170
303	ハイトマスタ (場所:綾部)	HME-600DM	ミツトヨ	150	170
304	ハイトゲージ (場所:綾部)	HDM-100AHD-30A,HS-30	ミツトヨ	100	110
305	マイクロメータ (場所:綾部)	MDC-25MJ他	ミツトヨ	100	110
306	内測マイクロメータ (場所:綾部)	HT-12ST他	ミツトヨ	100	110
307	セラミックブロックセット (場所:綾部)	BM3-112-K	ミツトヨ	350	390
308	ゲージブロックセット (場所:綾部)	No.613802-013 他	ミツトヨ	200	220
309	携帯用表面粗さ計 (場所:綾部)	SJ-301/0.75mN	ミツトヨ	450	510
330	レーザ顕微鏡 (場所:綾部)	LEXT OLS3100	オリンパス	2,140	2,430
353	CNC三次元測定機 (場所:綾部)	Crysta-ApexC9166	ミツトヨ	3,260	3,710
354	表面粗さ・輪郭形状測定機 (場所:綾部)	SV-C4000CNC	ミツトヨ	1,930	2,200
355	真円度・円筒形状測定機 (場所:綾部)	RA-H5100CNC	ミツトヨ	2,340	2,660
356	リングゲージ (場所:綾部)	No.177-146他	ミツトヨ	150	170
386	三次元光学プロファイラー (場所:綾部)	NewView8300	ザイゴ	3,770	4,290
2 材料試験用					
015	万能材料試験機(UCT-25T・250kN)	UCT-25T	オリエンテック	1,930	2,200
061	デジタルロックウェル硬さ試験機	ARD型	アカシ	200	220
129	広範囲荷重摩耗試験機	NUS-ISO-3	スガ試験機	100	110
139	マイクロビッカース硬さ試験機	HMV2000AD	島津製作所	250	280
178	万能材料試験機(UH-1000kNI・1000kN)	UH-1000kNI	島津製作所	3,060	3,480
189	ナノインデンテーション試験機	ENT-2100	エリオニクス	1,830	2,080

312	ひずみゲージ式センサ・アンプユニット (場所:綾部)	LU-100KE,LU-1TE,LU-10TE,AS-10HB,AS-100HA,PG-10KU,PG-100KU,DT20D,DPM-712B	共和電業	200	220
314	ロックウェル硬さ試験機 (場所:綾部)	ARK-600	ミツトヨ	400	450
315	マイクロビッカース硬さ試験機 (場所:綾部)	FM-700	フューチャテック	450	510
316	簡易携帯硬さ試験機 (場所:綾部)	エコーチップ	プロセク	200	220
317	反発式ポータブル硬さ試験機 (場所:綾部)	HARDMATIC HH-411	ミツトヨ	100	110
325	電気マッフル炉 (場所:綾部)	FUM332PA	アドバンテック東洋	150	170
328	FFTアナライザー (場所:綾部)	EDX-2000A	共和電業	400	450
358	振動計 (場所:綾部)	VM-82	リオン	100	110
363	万能材料試験機(250kN) (場所:綾部)	AG-250kNIS MO	島津製作所	3,670	4,180
364	万能材料試験機(5kN) (場所:綾部)	AG-5kNIS	島津製作所	1,020	1,160
365	マイクロフォーカスX線透視装置 (場所:綾部)	SMX3000micro	島津製作所	3,870	4,410
385	機械振動周波数分析システム (場所:綾部)	EDX-200A-1	共和電業	300	340
396	赤外線サーモグラフィ(R500EX-Pro) (場所:綾部)	R500EX-Pro	日本アビオニクス	560	630
509	マイクロフォーカスX線CTシステム	TOSCANCSSR-32300μFD	東芝ITコントロールシステム	4,080	4,650
517	万能材料試験機(E10000LT)	E10000LT	インストロン	4,890	5,570
518	万能材料試験機(E10000LT) (恒温槽仕様)	E10000LT	インストロン	5,910	6,730
538	万能材料試験機(68TM-30E2F2・30kN)	68TM-30E2F2	インストロン	3,700	4,210
539	万能材料試験機(68TM-30E2F2・30kN) (恒温槽仕様)	68TM-30E2F2	インストロン	5,100	5,810
540	万能材料試験機(68TM-30E2F2・30kN)用伸び計	68TM-30E2F2	インストロン	850	960
541	万能材料試験機用3D-DIC	VIC-3D	Correlated Solutions	1,300	1,480
542	万能材料試験機用ハイスピードカメラ	FASTCAM Nova S6	フォトロン	1,500	1,710
3 機械加工用					
310	タッピングボール盤 (場所:綾部)	KRT-340R	キラ・コーポレーション	100	110
311	手動折り曲げ機 (場所:綾部)	LD-414	盛光	100	110
319	鏡面ショット研磨機 (場所:綾部)	SMAP II 型	東洋研磨材工業	560	630
321	ベルト研磨機 (場所:綾部)	FS-2N	淀川電機製作所	200	220
322	両頭グラインダ (場所:綾部)	FG-205T	淀川電機製作所	150	170

323	高速切断機 (場所:綾部)	SK-1	昭和機械工業	100	110
324	帯ノコ盤 (場所:綾部)	VZ-300	ワイエス工機	100	110
359	旋盤 (場所:綾部)	LEO-80A	テクノワシノ	910	1,030
360	フライス盤 (場所:綾部)	KGJP-55	牧野フライス製作所	1,530	1,740
361	小型旋盤 (場所:綾部)	EB-10	エグロ	300	340
4 電気試験用					
155	光デバイス用自動光軸調整装置	U4224	駿河精機	1,020	1,160
184	低抵抗率計	Loresta-GP MCP-T610	三菱化学アナリティック	150	170
190	光コンポーネントアナライザシステム	N4375D	アジレントテクノロジー	5,610	6,390
191	ベクトルネットワークアナライザ	ME7838A	アンリツ	8,770	9,990
192	サンプリングオシロスコープ	86100D	アジレントテクノロジー	2,340	2,660
193	光スペクトラムアナライザ	AQ6370C(Z)	横河メータ&インスツルメンツ	610	690
194	電磁波シールド特性測定システム	N9000A	アジレントテクノロジー	510	580
326	シンクロスコープ (場所:綾部)	DL9040	横河電機	200	220
327	データレコーダー (場所:綾部)	LX-10	ティアック	200	220
367	ファンクションジェネレータ (場所:綾部)	SG-4105	岩通計測	100	110
368	ユニバーサルカウンタ (場所:綾部)	SC-7206	岩通計測	100	110
369	直流安定化電源装置 (場所:綾部)	PAN35-5A	菊水電子工業	100	110
370	EMC測定システム (場所:綾部)	GTEM750	シャフナー	3,570	4,060
507	ミックスドシグナルオシロスコープ	MS070804	テクトロニス	1,530	1,740
508	オシロスコープ	MD03054	テクトロニス	200	220
525	光学特性評価システム (大型積分球使用)	SR8-LED	システムロード社	5,810	6,620
526	光学特性評価システム (小型積分球使用)	SR8-LED	システムロード社	5,200	5,920
527	光学特性評価システム (可視光配光ユニット使用)	SR8-LED	システムロード社	5,400	6,150
528	光学特性評価システム (近赤外光配光ユニット使用)	SR8-LED	システムロード社	5,200	5,920
530	電磁波妨害評価試験装置(G-TEM) (エミッション測定)	GTEM 750,N9010A-507,A009K251-5757R,GA701M282-4850R-LCAなど	TESEQ,Keysight Technologies,アールアンドケー他	3,160	3,600

531	電磁波妨害評価試験装置(G-TEM) (イミュニティ試験)	GTEM 750,N9010A-507,A009K251-5757R,GA701M282-4850R-LCAなど	TESEQ,Keysight Technologies, アールアンドケー他	5,710	6,500
5 顕微鏡及び試料作製装置					
179	倒立型金属顕微鏡	GX51/DP72	オリンパス	860	980
331	金属顕微鏡 (場所:綾部)	TME200BD	ニコン	250	280
332	実体顕微鏡 (場所:綾部)	SMZ1000	ニコン	100	110
334	金相試料作製装置 (場所:綾部)	ラボプレス1, テグラポール21, テグラフォース3, テグラドーザ1, ディスコトム6	丸本ストルアス	6,220	7,090
371	走査電子顕微鏡 (SEM-EDS) (観察のみ) (場所:綾部)	JSM-6390LA	日本電子	3,360	3,830
372	走査電子顕微鏡 (SEM-EDS) (観察+元素分析) (場所:綾部)	JSM-6390LA	日本電子	4,990	5,680
373	デジタルマイクロスコプ (場所:綾部)	KH7700	ハイロックス	810	920
389	走査電子顕微鏡 (JSM-IT-300HR/LA)(観察のみ) (場所:綾部)	JSM-IT300HR 及び JED-2300 Analysis Station Plus	日本電子	3,460	3,940
390	走査電子顕微鏡 (JSM-IT-300HR/LA) (観察+元素分析) (場所:綾部)	JSM-IT300HR 及び JED-2300 Analysis Station Plus	日本電子	5,300	6,040
391	走査電子顕微鏡 (JSM-IT-300HR/LA) (観察+結晶方位分析) (場所:綾部)	JSM-IT300HR 及び JED-2300 Analysis Station Plus	日本電子	6,120	6,970
392	走査電子顕微鏡 (JSM-IT-300HR/LA) (観察+元素分析+結晶方位分析) (場所:綾部)	JSM-IT300HR 及び JED-2300 Analysis Station Plus	日本電子	7,850	8,940
394	クロスセクションポリッシャ (場所:綾部)	IB-19530CP	日本電子	810	920
397	コンタミネーション解析システム (場所:綾部)	RH-2000-PC	ハイロックス	1,420	1,610
409	クライオミル(場所:綾部)	CryoMill	ヴァーダー・サイエンティフィック	450	510
515	分析型走査電子顕微鏡 (SEM-EDS) (観察のみ)	JSM-7100F	日本電子	4,380	4,990
516	分析型走査電子顕微鏡 (SEM-EDS) (観察+元素分析)	JSM-7100F	日本電子	5,610	6,390
523	精密ダイヤモンドバンドソー	BS-300CL	メイワフォース	1,020	1,160
534	ナノサーチ複合型顕微鏡 (レーザー顕微鏡)	SFT-4500	島津製作所	3,300	3,760
535	ナノサーチ複合型顕微鏡 (レーザー+プローブ顕微鏡)	SFT-4500	島津製作所	6,500	7,410

536	ナノサーチ複合型顕微鏡 (試料調整:回転式マイクローム)	SFT-4500	島津製作所	2,000	2,280
6 分析用					
548	X線回折装置(定性)	SmartLab 3kW	リガク	4,300	4,900
549	X線回折装置(全仕様)	SmartLab 3kW	リガク	8,800	10,030
047	測色色差計	SQ2000	日本電色工業	300	340
105	電子線マイクロアナライザ(EPMA) (WDS)	JXA-8200	日本電子	5,200	5,920
107	電子線マイクロアナライザ(EPMA) (WDS(カラーマッピングを含む))	JXA-8200	日本電子	6,520	7,430
108	電子線マイクロアナライザ(EPMA) (全仕様)	JXA-8200	日本電子	7,240	8,250
176	FEオージェ電子分光分析装置 (全仕様)	PHI-700	アルバック・ファイ	11,220	12,790
177	FEオージェ電子分光分析装置 (イオン銃不使用)	PHI-700	アルバック・ファイ	8,160	9,300
181	炭素硫黄分析装置	CS-844	LECO	2,550	2,900
182	飛行時間型液体クロマトグラフ質量分析装置 (LC-TOF/MS)	micrOTOF2-kp	ブルカー・ダルトニクス	4,890	5,570
186	粒子径分布測定装置	SALD-2300	島津製作所	560	630
187	分光蛍光光度計	F-7000	日立ハイテクノロジーズ	610	690
195	蛍光マイクロプレートリーダー	SH-9000Lab	コロナ電機	810	920
196	レーザーラマン顕微鏡	RAMAN touch	ナノフoton	2,040	2,320
336	液体クロマトグラフ (場所:綾部)	Prominence	島津製作所	910	1,030
337	紫外・可視分光光度計 (場所:綾部)	V-630	日本分光	150	170
339	細管式レオメータ (場所:綾部)	CFT-500D	島津製作所	810	920
340	微量水分計 (場所:綾部)	CA-21	ダイアインスツルメンツ	610	690
341	ドラフトチャンバー (場所:綾部)	RFG-150SZ	ヤマト科学	910	1,030
342	示差走査熱量測定装置 (場所:綾部)	DSC-60A	島津製作所	760	860
343	レーザ回折式粒度分布測定装置 (場所:綾部)	SALD-2200	島津製作所	860	980
348	分光色差計 (場所:綾部)	NF-333	日本電色工業	100	110
375	X線回折装置Ⅱ (場所:綾部)	XRD-6100	島津製作所	1,630	1,850
376	分光蛍光光度計 (場所:綾部)	F-7000	日立ハイテクノロジーズ	610	690
377	フーリエ変換赤外分光光度計(赤外顕微鏡付) (場所:綾部)	IRPrestige-21AIM-8800	島津製作所	2,650	3,020

393	スパーク放電発光分析装置 (場所:綾部)	PDA-7000	島津製作所	2,750	3,130
395	蛍光X線分析装置(EDX-7000) (場所:綾部)	EDX-7000	島津製作所	1,730	1,970
405	ガスクロマトグラフ質量分析装置 (GCMS-QP2020 NX)(オプションなし)(場所:綾部)	GCMS-QP2020 NX	島津製作所	4,300	4,900
406	ガスクロマトグラフ質量分析装置 (GCMS-QP2020 NX)(パイロライザー)(場所:綾部)	GCMS-QP2020 NX	島津製作所	6,000	6,840
407	ガスクロマトグラフ質量分析装置 (GCMS-QP2020 NX)(ヘッドスペースサンプラー) (場所:綾部)	GCMS-QP2020 NX	島津製作所	5,200	5,920
408	ガスクロマトグラフ質量分析装置 (GCMS-QP2020 NX)(ダイレクトインジェクション) (場所:綾部)	GCMS-QP2020 NX	島津製作所	4,400	5,010
505	顕微紫外可視近赤外分光光度計	MSV-5200 DGK	日本分光	3,570	4,060
510	イオン分析計	DionexICS-1100	サーモフィッシャーサイエンティ フィック	960	1,090
511	示差熱・熱重量測定装置	DTG-60H	島津製作所	660	750
512	示差走査熱量計	DSC-60Plus	島津製作所	860	980
513	熱機械分析装置	TMA-60	島津製作所	1,120	1,270
514	熱伝導率測定装置	LFA467	ネッチ・ジャパン	2,140	2,430
519	グロー放電発光分析装置	GD Profiler2	堀場製作所	7,650	8,720
521	X線光電子分光分析装置 (イオン銃)	PHI5000VersaProbe2	アルバック・ファイ	10,200	11,620
522	X線光電子分光分析装置 (ガスクラスタイオン銃)	PHI5000VersaProbe2	アルバック・ファイ	13,260	15,110
532	分光エリブソメータ	UVSEL2	堀場製作所	8,670	9,880
533	テラヘルツ非破壊検査装置	TAS7500TS	アドバンテスト	10,200	11,620
543	波長分散型蛍光X線分析装置	ZSX PrimusIV	リガク	5,600	6,380
544	ハンドヘルド蛍光X線分析装置	Niton XL2-Plus	Thermo Fisher Scientific	1,000	1,140
545	高速液体クロマトグラフ(HPLC)	Nexera XR	株式会社島津製作所	3,800	4,330
546	フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)	FT/IR-6XFVST	日本分光株式会社	2,300	2,620
547	フーリエ変換赤外分光光度計 (FT-IR)(赤外顕微鏡)	FT/IR-6XFVST	日本分光株式会社	4,200	4,780
7 表面処理・環境試験用					
048	ポテンショスタット	HZ-5000	北斗電工	250	280
076	温湿度サイクル試験装置	PSL-2K	エスベック	710	800
180	超低温恒温器	MC-811P	エスベック	400	450
199	蛍光X線膜厚計	EA6000VX	日立ハイテクサイエンス	2,040	2,320
313	振動試験機(16kN) (場所:綾部)	F-16000BDH/LA16AW	エミック	2,650	3,020
344	温湿度サイクル試験装置(800L) (場所:綾部)	PL-4K/P計装	エスベック	960	1,090
345	小型高温チャンバー (場所:綾部)	ST-120B1	エスベック	100	110
346	接触角測定装置 (場所:綾部)	FTA-125	FTA	560	630
347	真空定温乾燥器 (場所:綾部)	DP43	ヤマト科学	350	390
357	騒音計 (場所:綾部)	NL-22	リオン	100	110

383	電磁・渦電流膜厚計 (場所:綾部)	LZ-200J	ケット科学研究所	200	220
384	振動レベル計 (場所:綾部)	VM-53A	リオン	100	110
503	耐候性評価システム (キセノン)	XER-W75	岩崎電気	1,630	1,850
504	耐候性評価システム (メタルハライド)	SUV-W161	岩崎電気	1,530	1,740
506	表面物性試験装置(CSR-2000)	CSR-2000	レスカ	3,060	3,480
537	冷熱衝撃試験装置(TSA-103ES-W)	TSA-103ES-W	エスベック	2,200	2,500
8 微生物・食品試験用					
064	レオメータ	NRM-2010J-CW	不動工業	250	280
081	凍結乾燥機	FDU-1000	東京理化器械	200	220
183	リアルタイムPCR装置	Thermal CyclerDice RealTimeSystem 2	タカラバイオ	560	630
520	噴霧乾燥機	SD-1000	東京理化器械	400	450
529	超音波ホモジナイザー	Q500	Qsonica	150	170
9 映像・工芸技術用					
097	サンドブラスター	SGK-3型	不二製作所	150	170
351	ストロボスコープ (場所:綾部)	MS-600	菅原研究所	100	110
352	デジタルハイスピードカメラ (場所:綾部)	MEMORECAMfxK4	ナック	1,420	1,610
524	4Kメモリーカムコーダー	PXW-Z100	ソニー	100	110
10 造形・試作用					
140	高速三次元成形機(樹脂粉末積層3Dプリンタ)	RaFaEl 300F	アスペクト	7,030	8,010
162	3次元CAD	ThinkDesign	ThinkDesign	250	280
350	非接触3次元デジタイザ (場所:綾部)	VIVID9i	コニカミノルタセンシング	1,630	1,850
381	3Dプリンター(ラビッドプロトタイプ) (場所:綾部)	dimension Elite	Stratasys	3,060	3,480
398	高速開発支援センター 高精細3Dプリンタ (場所:綾部)	AGILISTA-3200	キーエンス	2,550	2,900
399	高速開発支援センター 3次元スキャナ (場所:綾部)	ATOS core45, 200500	Gom		
400	高速開発支援センター VDIシミュレーション (場所:綾部)	Mechanical Enterprise, CFD Enterprise, HFSSMaxwell 3D, ADINA, ソリッドワークス	ANSYS 他		
501	三次元スキャナ(3D Scanner)(本体)	FARO EdgeScanArm ES 9ft	ファロー	1,730	1,970
502	三次元スキャナ(3D Scanner)(ソフトウェア)	FARO EdgeScanArm ES 9ft	ファロー	910	1,030